

形位公差与技术测量



作者：杨恩烈，余锴坚编著

出版社：沈阳：辽宁科学技术出版社

出版日期：1981.11

总页数：283

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html>) 查找全本阅读方式

形位公差与技术测量 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html>

书名：形位公差与技术测量